

中央試驗所裝置利用申請書

Application Form for Use of Instruments
in Central Service Facilities for Research

26棟装置利用希望申請書(SEM) Application for SEM (Building No.26)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間(1~15日で3日間、16~月末で3日間)利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00~16:00/後半:16:00~22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の替わりにすべての希望日程に②と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、**初心者講習**が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。**初心者・初回講習**は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 今月の講習は火曜~金曜日に受付けます。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

FE-SEM-Fは初回講習修了者のみ利用可能です。

FE-SEM-F

Oct 2017

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望	⊗					⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望	⊗					⊗

FE-SEM-H

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望	⊗					⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望	⊗					⊗

FE-SEM-J

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望	⊗					⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望	⊗					⊗

Rules of the Application process for SEM, XPS-TR and Stylus Profilers (Building No.26)

Basic Procedure

1. Select three days per half month.
2. Select the time frame (9:00~16:00 or 16:00~ 22:00) that you prefer to use the instrument and insert checks or circles in the column of the table.

* Twice a month from the days you selected will be the available day to use the instrument.

- For the present, FE-SEM-F on Saturday opens only for users who attended the initial lecture course.

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a half month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For Beginners

- You must attend the beginner’s course if you are new to our facility. You must enter a check in the table of beginner’s course requirement.
- Beginner’s course generally starts at 9:00 AM. If you have a classwork, please let us know. we are happy to arrange the starting time of the beginner's course.
- The beginner’s course is held on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday this month.

For Undergraduate student

- **You are not allowed to use any of our instrument just by yourself after 16:00, if you are undergraduate student. After-16:00 Booking is not accepted neither.**

前半 (First half) 9:00~16:00
後半 (Second half) 16:00~22:00
講習希望 (Requirement of beginner’s training)

26棟装置利用希望申請書

(薄膜XRD, XRD)

Application for Thin-film XRD and XRD (Building No.26)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

Oct 2017

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（1～15日で3日間、16～月末で3日間）利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00～16:00/後半:16:00～22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 講習は月曜～金曜のみ受付けます。土曜日は受付けていません。
- ◆ XRDは学生実験中設定日の13:00～16:00は装置利用ができません。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

薄膜XRD / Thin-film XRD

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

XRD

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

Rules of the Application process for Thin-film XRD and XRD (Building No.26)

Basic Procedure

1. Select three days per half month.
 2. Select the time frame (9:00~16:00 or 16:00~ 22:00) that you prefer to use the instrument and insert checks or circles in the column of the table.
- Twice a month from the days you selected will be the available day to use the instrument.
 - You are not allowed to use XRD from 13:00 to 16:00, when the classwork are held.

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a half month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For Beginners

- You must attend the beginner’s course if you are new to our facility. You must enter a check in the table of beginner’s course requirement.
- Beginner’s course generally starts at 9:00 AM. If you have a classwork, please let us know. we are happy to arrange the starting time of the beginner's course.
- The beginner’s course is held Monday to Friday. Saturday is not acceptable.

For Undergraduate student

- **You are not allowed to use any of our instrument just by yourself after 16:00, if you are undergraduate student. After-16:00 Booking is not accepted neither.**

前半 (First half) 9:00~16:00
後半 (Second half) 16:00~22:00
講習希望 (Requirement of beginner’s training)

26棟装置利用希望申請書(XPS-TR)

Application for XPS-TR(Building No.26)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（1～15日で3日間、16～月末で3日間）利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00～16:00/後半:16:00～22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。（ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください）
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 講習は月曜～金曜のみ受け付けます。土曜日は受け付けていません。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

Oct

2017

XPS-TR

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						X
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						X
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						X
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						X
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						X

26棟装置利用希望申請書 (卓上SEM、触針段差計) Application for Table SEM and Stylus Profilers (Building No.26)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

Oct 2017

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間(1~15日で3日間、16~月末で3日間)利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00~16:00/後半:16:00~22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 講習は卓上SEM:火曜~金曜、触針段差計:月曜~金曜のみ受付けます。土曜日は受付けていません。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

卓上SEM / Table SEM

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望	⊗					⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望	⊗					⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望	⊗					⊗

触針段差計 / Stylus Profilers

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

26棟装置利用希望申請書

(FE-TEM, TEM-120)

Application for FE-TEM and TEM-120

(Building No.26)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（1～15日で3日間、16～月末で3日間）利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00～16:00/後半:16:00～22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。**(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)**

- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。
- ◆ 希望の記入順による優先順位は考慮されません。
- ◆ FE-TEM、TEM-120は土曜日の予約は受付けていません。
- ◆ FIBによるTEM試料作成とその後のTEM観察が必要な場合、別途申し込みが必要です。**TEMの装置利用申請はせず、まず担当河野までご相談ください。**

Oct 2017

FE-TEM

	月	火	水	木	金
	02	03	04	05	06
前半					
後半					
	09	10	11	12	13
前半	x				
後半	x				
	16	17	18	19	20
前半					
後半					
	23	24	25	26	27
前半					
後半					
	30	31			
前半			x	x	x
後半			x	x	x

TEM-120

	月	火	水	木	金
	02	03	04	05	06
前半					
後半					
	09	10	11	12	13
前半	x				
後半	x				
	16	17	18	19	20
前半					
後半					
	23	24	25	26	27
前半					
後半					
	30	31			
前半			x	x	x
後半			x	x	x

時間区分(time frame) / 前半 = 9:00 ~ 13:00, 後半 = 13:00 ~ 16:00

Rules of the Application process for FE-TEM, TEM-120 and FE-SEM-CZ (Building No.26)

Basic Procedure

1. Select three days per half month.
 2. Select the time frame (9:00~13:00 or 13:00~ 16:00) that you prefer to use the instrument and insert checks or circles in the column of the table.
- Twice a month from the days you selected will be the available day to use the instrument.

前半 (First half) 9:00~13:00
後半 (Second half) 13:00~16:00

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a half month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For All users

- You are able to book TEM(**Monday to Thursday**) and TEM-120 (**Monday to Friday**).
- We are closed on Sunday, the national holidays and holidays that Keio university sets.
- If your specimen needs to prepare by Focused ion beam(FIB), you have to book FIB first. Please contact to officer(Kawano). * Do not book FE-TEM for FIB specimen.

装置利用希望者(MPMS-1, MPMS-2) For MPMS-1 and MPMS-2 Users

◆MPMS-1, MPMS-2の利用申請書はありません。利用希望者は、

- 集合日:一次予約日
- 時間:16時
- 場所:26棟003号室

へ筆記用具持参の上集合してください。

◆Booking is not necessary for MPMS-1 and MPMS-2

All researchers who need to use MPMSs must come to our office with a writing tool.

- Date of Booking: Primary Booking Day
- Time: 16:00~
- Place: 26-003

36棟装置利用希望申請書 (SPM) Application for SPM (Building No.36)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間(1~15日で3日間、16~月末で3日間)利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00 ~ 16:00/ 後半:16:00 ~ 22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 講習は月曜~金曜のみ受け付けます。土曜日は受け付けていません。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

Oct

2017 SPM-1

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

SPM-2

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

SPM-3

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

36棟装置利用希望申請書 (MALDI-7090、エリプソメーター) Application for MALDI-7090 and Ellipsometer (Building No.36)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（1～15日で3日間、16～月末で3日間）利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00～16:00/後半:16:00～22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)

◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。

◆ 講習は月曜～金曜のみ受け付けます。土曜日は受け付けていません。

◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。

◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

Oct 2017

MALDI-7090

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

エリプソメーター / Ellipsometer

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31	01	02	03	04
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

36棟装置利用希望申請書
共焦点レーザー顕微鏡 (Confocal
laser scanning microscopy FLUO
VIEW) (Building No.36)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

Oct 2017 共焦点レーザー顕微鏡

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（1～15日で3日間、16～月末で3日間）利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00～16:00/後半:16:00～22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。長谷(内線48340)までご相談ください。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x

36棟装置利用希望申請書(生物系)

Application for Analytical Instruments for Biological Specimen (Building No.36)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間(1~15日で3日間、16~月末で3日間)利用希望日を選択し、希望する時間帯(前半:9:00~16:00/後半:16:00~22:00)に○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に◎と記入してください)
- ◆ 初めて装置を利用する場合、初心者講習が必要です。講習が必要な場合、講習希望欄に丸をつけてください。初心者講習は原則AM9時からです。授業等がある場合はご相談ください。
- ◆ 講習は月曜~金曜のみ受付けます。土曜日は受付けていません。
- ◆ 学部4年生のみでの後半時間帯(16時以降)の利用はできません。予約も受け付けません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

遺伝子検出 / Genetic detection

Oct 2017

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

電気泳動 / Electrophoresis

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31				
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

バイオ分光 / Bio Spectroscopy

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
前半						
後半						
講習希望						⊗
	09	10	11	12	13	14
前半	x					
後半	x					
講習希望						⊗
	16	17	18	19	20	21
前半						
後半						
講習希望						⊗
	23	24	25	26	27	28
前半						
後半						
講習希望						⊗
	30	31	01	02	03	04
前半			x	x	x	x
後半			x	x	x	x
講習希望						⊗

Rules of the Application process for SPM, MALDI-7090, Ellipsometer, Analytical Instruments for Biological Specimen, Confocal laser scanning microscopy and XRD (Building No.36)

Basic Procedure

1. Select three days per half month.
 2. Select the time frame (9:00~16:00 or 16:00~ 22:00) that you prefer to use the instrument and insert checks or circles in the column of the table.
- Twice a month from the days you selected will be the available day to use the instrument.
 - We are closed on Sunday, the national holidays and holidays that Keio university sets.

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a half month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For Beginners

- You must attend the beginner’s course if you are new to our facility. You must enter a check in the table of beginner’s course requirement.
- Beginner’s course generally starts at 9:00 AM. If you have a classwork, please let us know. we are happy to arrange the starting time of the beginner's course.
- The beginner’s course is held Monday to Friday. Saturday is not acceptable.

For Undergraduate student

- **You are not allowed to use any of our instrument just by yourself after 16:00, if you are undergraduate student. After-16:00 Booking is not accepted neither.**

前半 (First half) 9:00~16:00
後半 (Second half) 16:00~22:00
講習希望 (Requirement of beginner’s training)

22棟・微細加工室 装置利用希望申請書
 (EB描画装置)
 Application for EB lithography system
 (Building No.22)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

※下青枠内どちらかに○をつけてください。クリーンルーム利用説明会へ参加しましたか？
 * Please mark one of them. Did you attend the user training course for the clean room?

Oct 2017

参加済み / already attend 未参加 / never attend

- ◆ 利用は原則的に、クリーンルーム**利用説明会への参加者**が対象です。
- ◆ 利用したい装置について、半月毎に3日間（**1～15日で3日間、16～月末で3日間**）利用希望日を選択し、○をつけてください。利用希望日6日間の内、月に2回(月前半1回、後半1回)が利用可能日となります。**(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)**
- ◆ 利用可能時間帯は9時～22時ですが、学部4年生のみでの16時以降の利用はできません。
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。

EB描画装置 / EB lithography system

	月	火	水	木	金	土
	02	03	04	05	06	07
利用希望						
	09	10	11	12	13	14
利用希望	x					
	16	17	18	19	20	21
利用希望						
	23	24	25	26	27	28
利用希望						
	30	31				
利用希望			x	x	x	x

Rules of the Application process for EB lithography system in the clean room (Building No.22)

Basic Procedure

1. Select three days per half month.
 2. You can use the EB lithography system from 9:00~22:00.
- ☐ Twice a month from the days you selected will be the available day to use the instrument.

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a half month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For All Users

- Person who attend the user training course for the clean room is allow using the clean room.
- The clean room in building No.22 is open from 9:00 to 22:00.
- We are closed on Sunday, the national holidays and holidays that Keio university sets

For Undergraduate student

- **You are not allowed to use any of our instrument just by yourself after 16:00.**

36棟・中央試験所・東陽テクニカ産学連携室
 ナノイメージングセンター 利用申請書
 (X線CT、ナノインデント、走査型電子顕微鏡)

Application for X-ray CT, Nano Indenter and Merlin, Keio-Toyo Nanolmaging Center (Building No.36)

学科名 / Department			
研究室 / Supervisor		内線番号 / Extension	
予約者名学年 / Your Grade		予約者名(カタカナ) / Your Name	

Oct 2017

- ◆ 依頼分析装置です。オペレーターが操作し、データを提供します。
- ◆ 利用したい装置について、1月毎に3日間 利用希望日を選択し、○をつけてください。利用希望日3日間の内、月に1回が利用可能日となります。**(ただし、応用化学科の研究室については、3日間のうち2回利用したい場合には○の代わりにすべての希望日程に②と記入してください)**
- ◆ 日曜日、祝祭日、学校が定める休日、中央試験所閉所日は予約できません。
- ◆ 希望の記入順による優先順位は考慮されません。

走査型電子顕微鏡 / Merlin

	月	火	水	木	金
	02	03	04	05	06
利用希望		x	x	x	x
	09	10	11	12	13
利用希望	x	x	x	x	x
	16	17	18	19	20
利用希望		x	x	x	x
	23	24	25	26	27
利用希望		x	x	x	x
	30	31			
利用希望		x	x	x	x

X線CT / X-Ray CT

	月	火	水	木	金
	02	03	04	05	06
利用希望			x	x	x
	09	10	11	12	13
利用希望	x			x	x
	16	17	18	19	20
利用希望			x	x	x
	23	24	25	26	27
利用希望			x	x	x
	30	31			
利用希望			x	x	x

ナノインデント / Nano Indenter

	月	火	水	木	金
	02	03	04	05	06
利用希望			x	x	x
	09	10	11	12	13
利用希望	x	x	x	x	x
	16	17	18	19	20
利用希望			x	x	x
	23	24	25	26	27
利用希望			x	x	x
	30	31			
利用希望			x	x	x

Rules of the Application process for instruments in Keio-Toyo Nanolmaging Center (Building No.36)

Basic Procedure

1. Select three days per a month.

☐ Once a month from the days you selected will be the available day to apply the instrument.

For Users of Department of Applied Chemistry

When you prefer to use instruments twice a month, you should fill the column of the table with “2”, instead of marks, such as a check or a circle.

For All Users

- We will accept your analysis request and provide data for you.
- We are closed on Saturday, Sunday, the national holidays and holidays that Keio university sets.